

## リモートパーティクルカウンタ

## R4800/R4900

## 長寿命レーザ光源（3年保証）

- プロセスエリアの清浄度多点モニタリングに！
- 0.3または0.5 $\mu$ m感度
- サンプル流量28.3 $\ell$ /分、2.83 $\ell$ /分
- 2粒径同時計数
- R4800シリーズ:RS485出力
- R4900シリーズ:DC4~20mA



プロセスエリアの清浄度多点モニタリングに

JIS B 9921 (1997) 準拠

仕様	
測定粒子径	R4803/4903: 0.3/0.5 $\mu$ m R4805/4815/4905/4915: 0.5/5.0 $\mu$ m
吸引流量	R4803/4805/4903/4905: 2.83 $\ell$ /分 R4815/4915: 28.3 $\ell$ /分
光源	半導体レーザ
同時計数誤差	R4803/4805/4903/4905: 5%以下、最大濃度2,000,000個/28.3 $\ell$ R4815/4915: 5%以下、最大濃度400,000個/28.3 $\ell$
流量調整	クリティカルオリフィス (-0.051MPa=-380mmHg以上の真空源)
電源	6Vdc @ <250mA
出力	R4800シリーズ: RS-485 R4900シリーズ: DC4-20mA
寸法	94(W)×38(D)×47(H)mm
重量	0.3kg
動作環境	温度12~29 $^{\circ}$ C、湿度20~95% (結露なきこと)
保管環境	温度-40~70 $^{\circ}$ C、湿度0~95% (結露なきこと)

## 本体外観図

## R4800/4900シリーズ

\*4815/4915の吸引口は、1/4in (6.35) OD

